

第94回分析基礎セミナー

プロに学ぶ・表面分析

【日時】 2015/6/25 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・西講義棟3階第4講義室

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社島津製作所

13:00-14:30 「X線光電子分光法の基礎と応用」

表面数ナノメートルの世界は、その組織、構造、物性等においてバルクとは全く異なった性状であることがしばしばです。またその表層数ナノメートルにのみ所要の特性を付加する技術も日々進歩しています。極表面のキャラクタリゼーションの解明に今やなくてはならない存在になっているXPS分析手法について、基礎から応用を解説していきます。

14:40-15:50 「電子線プローブマイクロアナライザ【EPMA】の

基礎と最新のアプリケーションのご紹介」

EPMAの原理や構造、SEM+EDSとの特長比較、そして最新のアプリケーションをご紹介します。

15:55-17:00 「走査型プローブ顕微鏡【SPM】の基礎と応用」

SPMについて、多彩な機能・モード、性能、およびそのアプリケーションを紹介します。

今年度の分析基礎セミナーは、過去に好評を博した「プロに学ぶ」シリーズです。機器メーカーならではのプロフェッショナルな内容にご期待ください。

今回は表面分析です。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力お願いします。途中入退室も自由ですのでご都合に合わせてご参加ください。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp